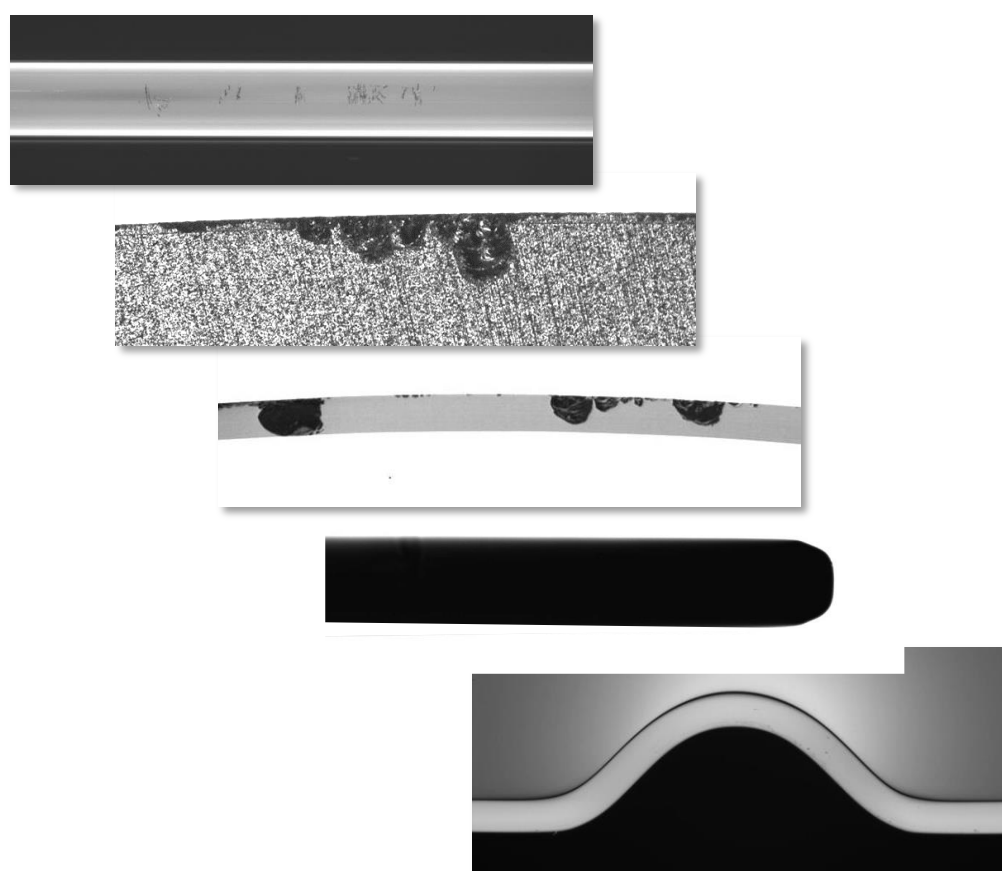


ウェハエッジ検査装置

WAFER EDGE INSPECTION SYSTEM

SEL-WEISシリーズ

- ウェハの外周部分のチッピング(欠け)や異物を自動検査
- 検出する欠陥のサイズを自由に設定可能(光学方式と画像処理方式)。
- 欠陥のあるウェハを色分け表示。
欠陥の位置をマップ表示。

特許取得済

《特長》

- ・検出する欠陥のサイズを自由に設定可能。
- ・他に類を見ない解像度。
- ・ノッチ部分、オリフラ部分の欠陥も検出。(APEX含む)
- ・プロファイル測定可能。
- ・透明・半透明ウェハの場合、内部に混入している異物や欠陥も検出可能。
- ・ノッチ・オリフラ位置はアライナーを使用せず画像で検出。
- ・光源にLEDを使用している為、ランニングコストが殆ど掛からない。
- ・スリムでレイアウトが容易。

《欠陥検出可能ウェハ》

- ・ベアウェハ
- ・パターン付ウェハ
- ・薄ウェハ／厚ウェハ(反りがあっても問題ありません)
- ・化合物ウェハ
- ・透明・半透明ウェハ(SiC, LN/LT, ...)
- ・エピウェハ
- ・ノッチのベベル・APEX



SPEC SHEET				
	WEIS－100	WEIS－150	WEIS－200	WEIS－300
	4inch	6inch	8inch	12inch
検査対象ウェハ	・原則、ウェハの種類は問いません。			
検査内容	欠陥の検出・表示			
表示方法	・欠陥を検出したウェハの番号を表示。 ・欠陥位置座標をマップで表示。 ・画像を自動保存。(異常箇所・正常箇所)			
スループット	約3. 5秒／1枚		約4. 5秒／1枚	別途お打合せ
	※上記時間は検査時間のみです。			
照明	LED			
GUI	タッチパネル			
搬送系	カセット　： 上下動エレベータ 搬送アーム　： 一軸 検査ステージ　： 回転ステージ			別途お打合せ
装置サイズ	W:650 X D:1000 X H:1700			別途お打合せ
ユーティリティ	AC100V　VA:2K(MAX) 圧空			別途お打合せ
重量	約400kg		約450kg	別途お打合せ
※サイズ違いのウェハの検査が1台で兼用出来ます。 ※ノッチのAPEX部分の検査に付いては別途ご相談ください。				

オプション	
異物検査	内部に異物が混入している欠陥の検出機能です。 (パターンが入ったウェハは異物検査は不可です)
上位通信	工場側の上位PCとの通信機能(SECS, GEM300など)
その他	2カセット仕様、FFU、イオナイザー

検査画面

検査

レシビ名: JustParameter(AND) Lot No.:

No.	開始時間	終了時間	チップ位置	カラー	判定
25					未判定
24					未判定
23					未判定
22					未判定
21					未判定
20					未判定
19					未判定
18					未判定
17					未判定
16					未判定
15					未判定
14					未判定
13					未判定
12					未判定
11					未判定
10					未判定
9					未判定
8					未判定
7					未判定
6					未判定
5					未判定
4					未判定
3					未判定
2					未判定
1					未判定

UPPER

APEX

LOWER

検査結果

ブザーOFF

検査中 (6/64)

開始

停止

結果表示画面

検査結果

レシビ名: JustParameter(AND)(大まめ) Lot No.:

No.	チップ位置	判定
25	9	OK
24	9	OK
23	-	-
22	-	-
21	-	-
20	-	-
19	-	-
18	-	-
17	-	-
16	-	-
15	-	-
14	-	-
13	-	-
12	-	-
11	-	-

選択中のLOT開始時刻
2015年03月24日 15時25分33秒

2015年03月24日 15時25分33秒

表示

表示

異物情報表示/切替

X = 48

チップ位置 Y = 184

画素 = 2658

ウェハマップ

再検査

表示

裏面

削除

検査パラメータ

検査条件: AND

画素: 50

長さ (ピクセル): 50

検査範囲 (ピクセル): 500

縦横比 (縦:横): 15:40

画素保存

閉じる

欠陥の位置をマップ表示

